



趣 旨

本スクールは、文部科学省ナノテクノロジー・ネットワーク事業の一環として、産学官の研究者に電子線描画リソグラフィ技術を中心とした超微細加工に関する装置やその原理を学習する場と、電子線描画リソグラフィ技術を実地に習得する機会を提供し、ナノテクノロジーにおける人材育成に貢献することを目的としています。

主 催

山口大学 産学公連携・イノベーション推進機構
東京工業大学 電子ビームによるナノ構造造形・観察支援

プログラム

本スクールでは、電子線描画リソグラフィ技術およびフォトリソグラフィに関する講義 4 コマを行います。
また、希望者に対して、電子線描画リソグラフィに関する実習を実施します。

- ・ 実習は関連する講義を受けることが必須となっています。
- ・ 講義のみの参加も可能です。

a) 講義

6月7日(火)、山口大学産学公連携・イノベーション推進機構 先端研究棟 3階セミナー室(山口大学常盤キャンパス)において、リソグラフィの専門家をお招きし、電子線描画リソグラフィ等についての最近の動向を講義頂くと共に、東工大関係者から電子線描画リソグラフィに関して実践的な講義を行います。

b) 実習

6月8日(水)から10日(金)にかけて、山口大学産学公連携・イノベーション推進機構 先端研究棟 1階クリーンルーム(山口大学常盤キャンパス)において、施設の装置を用いた1日間の実習を行います。

参加者が希望する加工パターンに即した実習も、個別に対応可能です(下記の実習日程表内の「電子線描画応用コース」)。ただし、この場合は、東京工業大学ナノテクノロジー・ネットワーク支援プログラムに申請していただくことが前提となります。

開催場所・定員・日程

a) 講義

- 開催場所 : 山口大学産学公連携・イノベーション推進機構 先端研究棟 3階セミナー室(山口大学常盤キャンパス)
◆山口大学常盤キャンパスへの交通アクセス → <http://www.eng.yamaguchi-u.ac.jp/10info/access.html>
- 定 員 : 40名
- 日 程 : H23年6月7日(火)13:00 ~16:30

時 間	講 義 内 容	講 師
13:00 - 13:10	挨拶	山口大学 / 山本 節夫
13:10 - 13:55	電子線用高解像度ネガ型レジスト TEBN-1 の開発と特性	(株)トクヤマ / 佐藤 誠
13:55 - 14:40	高精度電子ビームナノリソグラフィとその応用	NTT アドバンステクノロジー / 生津 英夫
15:00 - 15:45	電子線リソグラフィの高解像・高速化	日立中央研究所 / 山本 治朗
15:45 - 16:30	デバイス・プロセスを見込んだ電子ビーム露光	東京工業大学 / 宮本 恭幸
16:45 - 17:45	【実習参加者のみ】 実習実施に関する案内	

b)実習

■開催場所：山口大学産学公連携・イノベーション推進機構 先端研究棟 1階クリーンルーム(山口大学常盤キャンパス)

■定員：各コース 3名

■日程：H23年6月8日(水)～10日(金)のうち、各コース1日

* なお、実習実施に関する案内が6月7日(火)16:45-17:45にありますので、忘れずに必ず参加して下さい。

実習内容	定員(人)	期間(日)	日程	対象
電子線描画基本コース ¹⁾	3	1	6/8～6/9	経験不問
電子線描画応用コース ²⁾	3	1	6/10	経験者

1) 基本コースでは、高速トランジスタでのTゲート作製に用いられる、三層レジスト形成、露光というリソグラフィ工程の実習を行います。

2) 事前に希望があった場合に設定します。事前にプロセス内容に関する打ち合わせが必要となります。

実習概要

基本コースでは、高速トランジスタでのTゲート作製に用いられる、三層レジスト形成、露光というリソグラフィ工程の実習を行います。

費用

●参加費用は無料。但し、参加者の講義および実習開催場所までの交通費と食事、宿泊代は参加者負担。

応募条件

●学部卒業以上または、それと同等以上の経験を有する産学官の研究・開発従事者。

(大学院生は指導教員の許可を得ることが条件です。)

●電子線描画・微細加工に関する経験不問。

●実習期間中、各実習開催機関の安全ガイドラインと専任スタッフの指示を守る事。

募集期間

●平成23年4月20日～5月20日(正午)。原則として先着順。

参加申し込み方法、ならびにお問い合わせ先

●氏名、所属機関名および部署名、連絡先(電話番号およびE-mailアドレス)、実習参加希望の有無(基本コース or 応用コース)を、下記までE-mail、またはFAXでお申し込み下さい。

●同じグループから複数で応募される場合は、グループ毎にまとめてお申し込みいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

●なお、参加希望者多数の場合、調整させて頂く場合があります。

●スクールの内容等に関するお問い合わせは、下記までご連絡下さい。

【お問い合わせ先】山口大学 産学公連携・イノベーション推進機構

Tel; 0836-85-9976 Fax; 0836-85-9962

E-mail; nanotech@yamaguchi-u.ac.jp

受講者の選定方法

●上記の応募条件をもとに、原則として先着順。

その他

●講義のみの受講可。

●実習への参加に際しては、講義の受講が必須。